# **論文** レーザホログラフィ法による噴霧計測\* 3D Spray Measurement System for High Density Fields Using Laser Holography 姉崎幸信 調 尚孝 金原賢治 佐藤孝明 Yukinobu ANEZAKI Naotaka SHIRABE Kenji KANEHARA Takaaki SATO

A measuring technology to accurately analyze the process of disintegration into droplets is required in order to develop injection nozzles. The abilities required of a measuring device for spray droplets are: "the ability to measure the diameter of spray droplets in high-density fields", "the ability to measure the structure of spray droplets in 3D".

As a promising method to satisfy these requirements, the laser holography method has already been suggested. However, it has some drawbacks, such as the difficulty in measuring spray droplets in high-density fields. The authors have made some improvements to the optical system of recording. With these improvements, we have achieved a resolution of  $5.3 \,\mu\text{m}$  or higher in a space corresponding to the engine cylinder (high temperature and high pressure) and a measuring accuracy of  $0.16 \,\mu\text{m}$  in high-density fields.

In this paper, we report the analysis of droplet size of port fuel injectors and gasoline direct injectors, using the developed method.

Key words : Holography, Laser, Fan spray, Direct injection, Droplet size

## 1.はじめに

噴霧特性は,燃費・排気エミッションに影響を与え る主要因である.特に直噴ガソリンエンジンでは筒内 に直接燃料を噴射するため,噴霧特性が混合気形成お よびエンジン性能に及ぼす影響は大きい.エンジンの 燃焼コンセプトや運転条件に最適な状態で燃料を噴射 するノズルの開発・噴霧の数値シミュレーション技術 向上には,噴霧の分裂過程を正確に解析する計測技術 が必要不可欠である.

噴霧特性を代表するものとして,噴霧形状・微粒 化・燃料濃度がある.特に微粒化は噴霧の分裂状態を 示す重要な因子であるため,Table 1に示すように光 の干渉を利用したホログラフィ法,カメラによる直接 撮影,噴霧粒子のドップラ信号を利用したPDPA法,

|  | Laser holography           | Direct recording | DAT SA                      | Fraunhofer<br>diffraction method |
|--|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Minimum<br>measurable<br>droplet       | 3.5µm<br>Theoretical value | 30 µ m           | 1µm or less                 | 5µm                              |
| Measuring<br>area                      | whole spray                | 2×2mm            | 1droplet                    | ¢2mm                             |
| 3-D structure<br>analysis of<br>spray  | good<br>(Same spray)       | poor             | mediocre<br>(Average value) | poor                             |
| measuring<br>non-spherical<br>droplets | 900d                       | good             | poor                        | poor                             |
| Measuring time                         | mediocre                   | mediocre         | mediocre                    | good                             |

Table 1 Measuring methods of spray droplet

# 粒子の回折光分布から粒径分布を求めるレーザ光回折 法など,幾つもの計測装置が開発されてきた.

これらの手法を比較してみると,ホログラフィ法以 外は計測範囲が2mm以下と狭く,1回だけの噴射で は噴霧全域の計測が不可能なことが分かる.また、噴 霧粒子から発する信号(ドップラ信号,回折パターン) から粒径を計測するPDPA (Phase Doppler Particle Analyzer: 位相ドップラ粒径測定装置)やレーザ光回 折法は非球形粒子をノイズとして扱うため,非球形粒 子の計測が困難である.これに対しホログラフィ法は 1回の撮影で、噴霧全域における噴霧粒子1個1個の 形状と空間分布が計測可能である.このため,瞬時の 噴霧粒子の3次元空間分布や内部構造の解析が可能で あり,噴霧粒子そのものが計測できるため噴霧粒径計 測の原器として位置づけられている.しかし,ホログ ラフィ法をガソリン直噴インジェクタの噴霧計測に適 用するには、"高密度領域の噴霧計測が困難","撮影 は瞬時に終わるが,解析には多大な時間を要する"な どの点が課題となっていた.

この問題を解決するため本論分では,撮影光学系の 改良,自動解析装置の開発を試みた.撮影光学系には 噴霧以外のノイズを除去するため,噴霧と噴霧を撮影 する記録媒体の乾板との間にリレーレンズを設置し, レンズの焦点位置にピンホールを設けることで,噴霧 中心部における噴霧の輪郭を鮮明に撮影することを可 能とした.また、CCDカメラで撮影した噴霧粒子画

\* SAEの了解を得て, SAE2002-01-0739を和訳, 一部加筆して転載

Translated and reprinted with permission from SAE 2002-01-0739 (2002.3) (© 2002 Society of Automotive Engineers, Inc. )

像から輝度情報を利用し、CCDカメラの焦点面内に ある粒子のみを抽出する自動解析装置を開発した.こ れにより噴霧粒子の識別確率が向上し、短時間で噴霧 全域の解析が可能となった.

本論分では上記の改善項目に加え、精度検証結果お よびポート噴射用インジェクタ,直噴ガソリン用イン ジェクタの解析事例についても報告する.

## 2.ホログラフィ法の原理

ホログラフィ法は,被写体の3次元情報が記録可能 な写真撮影法のうちの一つである.ホログラフィ法の 撮影には,被写体に入射する光(物体光)と入射しな い光(参照光)が必要であり,物体光と参照光の入射 方法の違いからインライン法とオフアクシス法に分類 される,物体光と参照光が同一光路であり、物体光が 参照光の役割も兼ねたものをインライン法と呼び、参 照光と物体光が別光路であるものをオフアクシス法と 呼ぶ.一般に噴霧粒子計測には光学系の簡単なインラ イン法が用いられてきた()2)3)しかし、インライン法 では噴霧粒子を透過しない光が参照光となるため,雰 囲気密度や粒子密度が高い領域では鮮明な像が得にく い、そのため西田ら<sup>4)</sup>は、粒子密度が高い直噴スワー ル噴霧の解析をオフアクシス法で実施している.本論 分でも,光学系は複雑になるが"エンジン筒内環境下 での計測","高密度領域の噴霧粒径計測"を可能にす るため,オフアクシス法を選定した.

Fig. 1にオフアクシスホログラフィの原理を示す. ホログラフィ法は,撮影系と再生系の二つの光学系から構成される.撮影は,噴霧に照射した光と噴霧を通らない光を記録媒体である乾板上で交差させることで行う.このとき,物体光と参照光の光路差をレーザの可干渉距離内になるように調整すると乾板上に干渉縞が生じる.この干渉縞には噴霧粒子から伝播する光情報(輝度,光の方向)が含まれており,これを乾板に 露光することで記録する.撮影した乾板は、通常の写 真撮影と同じく現像処理を行う.

再生は,乾板の背面から光(再生光)を入射して行う.このとき再生光の入射角度を再生光と同一角度に すると、再生光は乾板に記録された干渉編によって回 折する。この回折により、再生光は撮影時の物体光と 同一位相の光波面に変換され,噴霧像が空間に結像す る.この再生像をCCDで拡大撮影し、粒子一粒ずつ の粒径を測定する.粒子の3次元構造は,粒子の位置

#### 情報をCCDの焦点位置から算出して求める.



Fig. 1 Principle of holography

## 3.実験装置

#### 3.1 撮影光学系

Fig. 2に,本研究で用いたオフアクシスホログラフ ィの撮影光学系を示す.光源にはパルスYAGレーザ (スペクトラフィジックス製 PIV200,波長532nm,出 力200mJ)を用いた. レーザの発光期間は7nsと極め て短時間であり、噴霧の静止画像の撮影が可能である. レーザにはインジェクションシーダが設けられてお り,可干渉距離を0.01mから2mまで拡大することで, 物体光と参照光の光路差が大きくなっても良好なホロ グラムの作成を可能とした.上記レーザから発振され た光は、ビームスプリッタで物体光と参照光に分割さ れる.物体光と参照光はそれぞれスペィシャルフィル タでビームの強度分布を均一にされたのち, 凸レンズ で拡大平行光に変換される.光量は光路上に設けた NDフィルタで調整する.拡大平行光に変換された物 体光は高温・高圧容器内に噴射された噴霧を通過後, リレーレンズ系(凸レンズ×2枚 f=150)とピンホ ールで構成されるノイズフィルタでノイズを除去され る.その後,噴霧を迂回した参照光と乾板(コニカ製 P5600B, 分解能7000本/mm) 上で交差し, 干渉縞が 乾板に記録される.乾板への物体光と参照光の入射角 度は回折効率が最大となる90°と45°とした。



Fig. 2 Recording optical system

高温・高圧容器は2.1kWのヒータと断熱材が内蔵し てあり、250 までの昇温が可能である、容器内には ファンを設置し、雰囲気を攪拌することで温度むら を±5 以内に維持している、容器の観察窓径は 90, 内部の寸法は110mm(H)×380mm(W)×200mm(D)で ある、容器内圧は窒素ガスを充てんすることで, 0.9MPaまでの加圧が可能である、また、本研究では 容器内にピストンを模擬した平板を設置することで, 壁面衝突噴霧の計測も実施した、



Fig. 3 High pressure and high temperature chamber

燃料の加圧は手押しポンプとアキュムレータで行った.供試燃料はn-ヘプタンを使用し,噴射期間と撮影タイミングはディレイパルスジェネレータ (Stanford Research System製 DG535,横河製)により 任意に設定が可能である.

#### 3.2 再生光学系

撮影した乾板は通常の写真と同様に現像・定着・漂 白処理を実施し、Fig. 4に示す光学系で再生する.再 生は連続発振のYAGレーザ(スペクトラフィジックス 製 Millennialls,波長532nm,出力500mW)を使用し た.レーザから発振した光は撮影時と同様にスペィシ ャルフィルタと凸レンズで拡大平行光に変換後,撮影 時の参照光と正反対の方向から乾板に入射される.こ れにより噴霧の再生像(実像)は,撮影時と同じ位置 に再生される(この手法を位相共役再生と呼ぶ).

次に,再生像を10倍の顕微鏡用対物レンズを取りつ けたCCDカメラ(東芝製,IK-SM43H)で拡大撮影し, 噴霧粒子画像をパソコンに取り込む.乾板とCCDカ メラは,それぞれ自動パルスステージ(シグマ光器製, CTS-100)に設置することで,乾板はX-Z平面上(上下 左右),CCDカメラはY方向(奥行き)の任意の位置 に移動可能である.これにより噴霧再生像とCCDの 相対位置を変更することで,再生像全域の噴霧粒子を スキャンした.CCDカメラの視野範囲は1×1.5mm, 被写界深度は0.3mmであるため,1ヶ所あたりの測定 体積は1×1.5×0.3mmとなる.噴霧粒径は,噴霧粒子 画像から画像解析装置(Media Cybernetic製,Image Pro)で粒子の等価円直径を求めることで行った.ま た,粒子の位置はCCDと乾板の相対距離から求めた. この装置により1回の噴射だけで,噴霧全域における 噴霧粒径の空間分布計測が可能である.



Fig. 4 Reconstruction optical system

## 4.ホログラフィシステムの改善

#### 4.1 撮影光学系

撮影光学系では,噴霧全粒子に対して粒子一粒ずつ 干渉縞を記録する.そのため,粒子密度が高い領域で は乾板の分解能への負担は大きい.乾板の分解能の負 担低減には,粒子の干渉縞の間隔を広くする方法と粒 子以外から発する光を記録しない方法がある.

粒子の干渉縞の間隔を広くするには,西田ら<sup>4)</sup>のようにリレーレンズを撮影時に用いないことで噴霧と乾板の距離を大きくし,粒子からの散乱光を拡大させて乾板に記録する方法がある.但し,粒子の散乱光強度は距離の2乗に比例して減衰するため、この方法では散乱光強度の減衰が大きくコントラストが低下する懸念がある.また,散乱光の拡散により干渉縞の直径も大きくなるため,粒子の高密度領域では干渉縞同士が重なり合うことで精度が低下する可能性がある(Fig. 5).



Fig. 5 Influence of distance from spray to holographic plate

これに対し、Katzら<sup>5)</sup>はピンスポットで粒子以外か ら発する光を記録しない方法を提案している.Katzら は凸レンズ2枚で構成されているリレーレンズ系のう ち、噴霧側の凸レンズの焦点にピンスポットを設置し, 粒子を通過しない物体光を除去することで乾板の分解 能への負担を低減している.この方法はリレーレンズ により噴霧像を乾板の近傍に結像するため,散乱光強 度の距離減衰が生じない。しかし,ピンスポットは物 体光のうちの平行光成分のみしか除去できないため, この手法では高温・高圧容器内でのハレーション,光 学部品に付着した埃・傷による回折光,レンズ,ND フィルタの反射光などの外乱光は除去できない.

そこで本研究では,光の距離減衰の防止と上記外乱 光の除去の両立を図るため,リレーレンズとピンホー ルで構成されるノイズフィルタを考案した.Fig.6に その原理を示す.一般に凸レンズで平行光を集光する と焦点に集光するが,点光源(散乱光)は焦点に集光 しない.この原理を利用し,リレーレンズ系の噴霧側 凸レンズの焦点位置にピンホールを設置することで, 平行光ではない外乱光の除去を行った.但し粒子の散 乱光も平行光ではないため,ピンホール径を粒子の散 乱光のみが通過できるように設定する必要がある.そ のためピンホールを円形開口と見なし,ピンホール径 を円形開口におけるフラウンホーファの回折の式 (Eq.1)から求めた.

$$D = \frac{\lambda \cdot f}{\pi \cdot d} \dots \text{Eq.1}$$

 $\lambda$  :Wave length f :focal length d :droplets size



Fig. 6 Principle of noise filter

#### 4.2 自動解析システム

本研究では計測時間の短縮を図るため、CCDカメ ラの移動から、画像の取り込み、粒径解析までを自動 で行う自動解析システムを構築した。自動解析を実現 するために、CCDカメラの焦点面内にある粒子と焦 点外の粒子の識別、およびCCDカメラの位置によっ て生じる粒子輝度の減衰補正、バックグランドノイズ 除去のアルゴリズムを開発した。Fig.7に噴霧粒子の 再生像を示す。CCDカメラの焦点深度内にある粒子 は輪郭がシャープに映っているが、焦点から外れた粒 子は輪郭がぼけて映っている。



Fig. 7 Reconstructed image of spray droplets

Fig. 8に, CCDカメラをY(奥行き)方向に移動さ せて同一粒子を撮影したときの粒子の輝度率(輝度/ 最大輝度)と, CCDカメラの移動距離の関係を示す. 粒子の輝度率は, CCDカメラの焦点内で極大値をと り,焦点外ではある一定値(しきい値)以下となって いる.またパックグランドノイズの輝度は, CCDカ メラの位置に関係なく,しきい値以下であった.よっ て,あるしきい値以上の粒子を抽出することで,焦点 面内の粒子のみの識別が可能である.しかし,このし きい値はFig. 8で示すように,粒子の最大輝度により 変化する.このため,粒子の最大輝度としきい値の関 係を実験で求めた.その結果,しきい値は最大輝度と 1次関数の関係であった(Fig. 9).本研究では,これ らの現象から粒子の識別アルゴリズムを構築し,自動 解析システムを完成させた.



Fig. 8 Relationship between the luminance factor and position of focus



Fig. 9 Relationship between the maximum luminance and the threshold value

## 5.精度検証

## 5.1 供試物体による検証

最小分解能の検証として,直径が5.3µmのワイヤ をホログラフィ法で計測した.その結果をFig. 10に 示す.ホログラフィ法で計測したワイヤの平均径は 6.0µmであり,誤差は0.7µmであった.



Fig. 10 Accuracy verification of minimum resolution

次に高密度領域での精度検証として,噴霧内に設置 したワイヤを計測した.インジェクタはファン噴霧直 噴ガソリンインジェクタを用いた.Table 2に実験条 件を示す.ワイヤは噴孔から30mm下方に設置した. PDPA法で計測した結果,この位置での燃料濃度は 0.002cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>・sである.Fig.11に結果を示す.ワイヤ 平均径58.25 µmであるのに対し,噴霧内のワイヤを ホログラフィで計測した結果は58.09 µm(誤差:0.16 µm)であった.以上より,ガソリン直噴インジェク 夕噴霧のように粒子密度が高い領域でも,高精度で計 測可能であることが確認できた.

Table 2 Test conditition for accuracy verification in high density fields

|       | Injector type       | Fan spray injector (prototype) |
|-------|---------------------|--------------------------------|
|       | Fuel                | N-heptane                      |
|       | Fuel pressure       | 13MPa                          |
|       | Injector quantity   | 15.9mm <sup>3</sup> /str       |
|       | Ambient pressure    | 0.1MPa.abs                     |
| Ambie | Ambient temperature | Room temperature               |
|       | Laser firing time   | 1.0ms from start of injection  |



Fig. 11 Accuracy verification in high density fields

噴霧のように多数の液滴群の計測への適用性を調べ るために、レチクルによる精度検証を実施した.レチ クルとはガラス基板の両面に、円形のクロム薄膜を噴 霧とほぼ同じ粒子密度となるように蒸着したものであ る、Fig. 12にホログラフィ法と顕微鏡で計測したレ チクルの粒径度数分布を示す.両計測手法の粒径分布 は傾向がほぼ一致しており、ザウター平均粒径 (Sauter Mean Diameter,以下SMD)もホログラフィ 法:48.6 µm,顕微鏡計測:48.8 µmと精度0.4%と高 い精度で計測できることを確認した.



Fig. 12 Accuracy verification using a reticle

#### 5.2 他の計測手法との比較

5.2.1 カメラによる直接撮影との比較

実噴霧計測への適応性を調べるため,噴霧計測に一般に使用されている手法であるカメラでの直接撮影法 とPDPA法との比較を実施した.

カメラによる直接撮影法との比較として,ポート噴 射インジェクタの噴霧計測を行った.直接撮影法では 粒子密度の高い直噴インジェクタ噴霧の解析が困難な ため、ポート噴射インジェクタを選定した.実験条件 をTable 3に示す.インジェクタは多孔(12孔)イン ジェクタを用いた.燃料の噴射圧力は500kPa,雰囲 気圧力は0.1MPa.absである.撮影時期は噴射開始後 7ms,測定位置は噴孔から50mm下方である.ホログ ラフィ法の計測領域は高さ1.0mm,幅50mm,奥行き 方向に40mmでCCDカメラ(視野範囲1mm×1.5mm) を2mm間隔で移動させてスキャンした(Fig. 13).カ メラによる直接撮影の視野範囲は高さ3mm,幅4mm である.

Fig. 14に粒度分布を示す.両計測とも40と60μmに ピークがあり,粒度分布は同様の傾向を示す.SMD は直接撮影法が71.7μm,ホログラフィ法は70.3μm とほぼ同じ値を示した.以上より,本装置は噴霧解析 に対しても十分な精度で計測可能であると判断できる.Fig.15に同一噴霧におけるポート噴射インジェクタの水平方向断面でのSMD分布を示す.Fig.15より, 噴霧外縁に比べ中心部に大きな粒子が存在していることがわかる。ホログラフィ法は3次元計測が可能であるため,粒子の空間分布の特徴を容易に把握できる.

| Injector type                           | Multi-holes Injector          |
|---|-------------------------------|
| Fuel                                    | N-heptane                     |
| Fuel pressure                           | 500kPa                        |
| Injector quantity                       | 4.9mm <sup>3</sup> /str       |
| Ambient pressure<br>Ambient temperature | 0.1MPa.abs                    |
|   | Room temperature              |
| Laser firing time                       | 7.0ms from start of injection |

Table 3 Test condition for port fuel injector



Fig. 13 Measunng point for a port fuel injector



Fig. 14 Comparison of droplet size distributions among holography and direct recording



Fig. 15 SMD distribution of a port fuel injector

#### 5.2.2 PDPAとの比較

次に高密度噴霧での精度検証として,直噴インジェ クタ噴霧を計測しPDPAと比較した.計測条件は燃圧 13MPa,雰囲気圧0.21MPa.abs,インジェクタはファ ン噴霧インジェクタとした(Table 2).ホログラフィ 法の撮影は噴射開始1ms後に行った.測定位置は,X 座標を噴霧中心と外縁の2ヶ所とし,Y座標を噴霧厚 み方向の中心軸上、Z座標を噴孔から30mm下方とし た(Fig. 16).PDPAは単発噴射ではサンプリング粒 子数が少ないため,10Hz間隔で200回噴射して計測し た.ホログラフィ法のサンプリング粒子数は噴霧中心 で45,外縁部で59なのに対し,PDPAは232と104であ る.



Droplet density : 0.002cc/cm<sup>2</sup>·S

Fig. 16 Measuring point for a fan spray

粒度分布をFig. 17に示す.両計測とも,噴霧中 心・外縁ともに粒径が20µm付近にピークがあり,分 布も似たような形状を示す.しかしホログラフィ法の 結果には,PDPAでは検出されない40~65µm以上の 粒子が存在している.これは,PDPAで計測する際に ノイズとして除去する非球形粒子だと考えられる. Fig. 18に,粒度分布から求めたRosin-Rammler線図を 示す.ホログラフィ法のRosin-Rammler線図は直線と なり,粒度分布は良好な正規分布を示す.これに対し, PDPAは40μm以下ではホログラフィ法と同様の特性 を示すが,40μmに変極点が存在する.PDPAの粒度 分布には40μm以上の粒子は検出されていないが, 100μm以上の粒子が存在する.PDPAではサンプリン グ数を補うため,燃料を数回噴射して計測する.これ により噴孔端部に燃料が付着し,噴射に伴い噴霧によ って引き千切られた燃料を検出したと考えられる.

上記のワイヤ計測,他の計測手法との比較結果から, 本装置はガソリン直噴噴霧計測を十分な精度で解析が 可能であると言える.



Fig. 17 Comparison of droplet size distributions among holography and PDPA



Fig. 18 Rosin-rammler diagram

## 6.直噴インジェクタ解析

#### 6.1 ファン噴霧の粒径分布

本計測システムを直噴噴霧計測に適用した例を以下 に示す.供試インジェクタはファン噴霧インジェクタ のプロトタイプを使用した.噴孔諸元をFig. 19に示 す.サック径および噴孔幅は1.0mm,0.185mmである. 噴孔中心軸はインジェクタ中心軸に対して横方向にオ フセットがある.実験は燃圧13MPa,雰囲気圧 0.21MPa.abs,撮影時期は噴射開始後1.0msの条件で 行った.実験条件をTable 4に示す.測定位置は噴孔 から30と40mm下方とした.噴霧厚み方向の中心軸上 を2mm間隔で幅32mmの範囲についてCCDでスキャン を行った(Fig. 20).1画像内(1mm×1.5mm)の粒 子数は,およそ50~200個である.測定の結果,噴孔 から30mm下方,40mm下方ともに,噴霧中心にくら ベ外縁部のSMDが大きいことが分かる(Fig. 21).

| Injector type       | Fan spray injector (prototype) |
|---------------------|--------------------------------|
| Fuel                | N-heptane                      |
| Fuel pressure       | 13MPa                          |
| Injector quantity   | 24mm³/str                      |
| Ambient pressure    | 0.21MPa.abs                    |
| Ambient temperature | Room temperature               |
| Laser firing time   | 1.0ms from start of injection  |



Fig. 19 Nozzle geometries







Fig. 21 SMD distribution of fan spray

#### 6.2 平板衝突噴霧解析

最後に筒内環境における噴霧解析として、ピストン を模擬した平板に衝突する噴霧の計測例を示す.実験 条件は,雰囲気圧0.3MPa,雰囲気温度206 ,平板温 度130 である(Table 5).上記条件は,エンジン実 機における1200r/min,37Nmのアイドリング条件相 当の値である.インジェクタと平板の位置関係と測定 位置をFig. 22に示す.なお,インジェクタは5.1.の自 由噴霧計測で使用したものとした.(Fig. 19)

Table 5 Test condition for impinging spray

| Injector type       | Fan spray injector (prototype) |
|---------------------|--------------------------------|
| Fuel                | N-heptane                      |
| Fuel pressure       | 11MPa                          |
| Injector quantity   | 13.6mm³/str                    |
| Ambient pressure    | 0.3MPa.abs                     |
| Ambient temperature | 479K                           |
| Wall temperature    | 403K                           |



Fig. 22 Impinging condition and measuring point

Fig. 23に平板衝突噴霧の散乱光写真とSMD,噴霧 粒径の度数分布を示す。同一測定位置でのSMDを比 較すると,時間の経過と共にSMDは大きくなる。度 数分布については,時間の経過と共に20µm程度の粒 径は減少するが,40µm以上の粒子数には変化があま りないことが分かる。以上から,噴霧が壁面に衝突す ると壁面から熱を授与し小粒子は蒸発するが,大粒子 は蒸発しきれずに残留するため,SMDは見かけじょ う大きな値を示すと考えられる。また噴霧先端部にお けるSMDの時間変化に着目してみると,同様に大粒 子が残留していることが分かる。



Fig. 23 Droplet size distribution of impinging spray

7.おわりに

本研究では,噴霧解析手法としてホログラフィ法に よる噴霧粒径計測装置を開発した.この装置は従来の 撮影光学系に,リレーレンズとその中心位置にピンホ ールを設置したノイズ除去機構を組み込むことで,噴 霧粒子以外のノイズを除去し良好なホログラムの撮影 を可能とした.また,再生系にはCCDカメラの焦点 面内にある粒子と焦点面外の粒子を輝度変化により自 動識別するアルゴリズムを構築することで,解析時間 の短縮を図った.

以上の改良を実施することで,計測範囲: 5.3 µm 以上,高密度領域での精度: 0.16 µm(ワイヤ計測時), 噴霧と同等の分布を持ったクロム円盤(レチクル)の SMDを0.4%の精度で計測可能となった.

上記計測装置をファン噴霧直噴インジェクタの自由 噴霧解析に適用した結果,噴霧中心部にくらべ外縁部 に大きな粒子が分布していることがわかった.また, ピストンを模擬した平板に噴霧を衝突させ、衝突前後 の粒径を計測した結果,噴霧が壁面に衝突すると小粒 子は蒸発し,大粒子は蒸発しきれずに残留するため, SMDは見掛け上,大きくなることが分かった.

## 8.謝辞

多大なご協力を頂いたトヨタ自動車殿に厚く感謝の 意を表します.

## <参考文献>

- 1) M.Masuda, H.Yano, T.Aoki, K.Matsuo: "Particle Sizing with Inline Laser Holography using an Ultraviolet Laser ", Journal of the visualization society of Japan, Vol18 (1998), pp71-72.
- H. Meng, J. Estevadeordal, S. Gogineni, L. Goss, W. M. Roquemore: "Holographic Flow Visualization as a tool for studying 3D Coherent Structures and Instabilities ", Proceedings of The Second Inter national Workshop on PIV ' 97-Fukui (1997), pp.27-34.
- H. Meng, F. Hussain: "In-Line recording and Offaxis viewing technique for holographic particle velocimetry ", Applied Optics Vol.34, No.11 (1995), pp.1827-1840.

- M. Yamakawa, K. Nishida, M. Kamikawa, T. Yoshizaki, H. Hiroyasu: "Development of Three Dimensional Measurement System for Droplet Size Distribution via Pulsed Laser Holography Method ", Jounal of the ILASS-Japan, Vol.8, No.23 (1999), pp.130-137.
- 5) J. Zhang, J. Katz, "Off-axis HPIV with Forward Light Scattering from Particles ", ASME 1994, FED-Vol.191 (1994), pp.173-177.

調 尚孝

佐藤 孝明

<著 者>



姉崎 幸信 (あねざき ゆきのぶ) (株)日本自動車部品総合研究所 第1研究室 パワートレイン分野の受託研究に従事



金原 賢治 (かねはら けんじ) (株)日本自動車部品総合研究所 第1研究室 パワートレイン分野の受託研究に従事



(しらべ なおたか) (株)日本自動車部品総合研究所 第1研究室 パワートレイン分野の受託研究に従事



(さとう たかあき) (株)日本自動車部品総合研究所 第1研究室 パワートレイン分野の受託研究に従事